

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成26年12月25日(2014.12.25)

【公開番号】特開2014-48176(P2014-48176A)

【公開日】平成26年3月17日(2014.3.17)

【年通号数】公開・登録公報2014-014

【出願番号】特願2012-191912(P2012-191912)

【国際特許分類】

G 01 J 3/02 (2006.01)

G 01 N 21/17 (2006.01)

G 01 N 21/27 (2006.01)

【F I】

G 01 J 3/02 Z

G 01 N 21/17 D

G 01 N 21/27 Z

【手続補正書】

【提出日】平成26年11月12日(2014.11.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

- a) 光源室と、
- b) 前記光源室と断熱部を隔てて分離された、少なくとも分光素子、試料室及び検出器を備えた分光室と、
- c) 前記分光室内の温度を測定する温度測定手段と、
- d) 前記分光室の内部を加熱及び/又は冷却する温度調節手段と、
- e) 前記温度測定手段より温度情報を取得し、前記分光室内を予め定められた設定温度に維持するように前記温度調節手段を動作させる制御手段と
を備えることを特徴とする分光光度計。

【請求項2】

前記分光室において、前記分光素子、前記試料室、前記検出器をそれぞれ必要な距離を隔てて配置することを特徴とする請求項1に記載の分光光度計。

【請求項3】

前記設定温度が室温よりも高い温度であることを特徴とする請求項1又は2に記載の分光光度計。

【請求項4】

液体クロマトグラフの検出部に用いられることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の分光光度計。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

本発明では、温度測定手段からの温度情報を基づいて分光室の温度をフィードバック制

御するため、高い精度で分光室内の温度を予め定められた設定温度に維持することができる。また、温度調節手段は分光室の内部全体の温度調節を行うため、その中に備えられた分光素子、試料室及び検出器が同時に温度調節される。そのため、それらの間に温度差が生じることが少なく、高精度の分光分析を行うことができる。

分光室において、分光素子、試料室、検出器をそれぞれ必要な距離を隔てて配置することにより、このような空間的均一性の他、時間的安定性の効果もある。すなわち、分光室内で分光素子、試料室、検出器がそれぞれ必要な距離・空間を隔てて配置されているため、分光室内には比較的大きな空間が存在する。本発明では、この大きな空間の全体を温度調節するため、時間的な温度変化（ゆらぎ）も小さくなり、安定性の高い、また、再現性の良い分析を行うことができる。